

OPIE'21 併設セミナー／併催イベント一覧

	6月30日(水)			7月1日(木)			7月2日(金)			
	AM	PM		AM	PM		AM	PM		
アネックスホール F201	9:30-12:25 宇宙・天文光学 SA-1			9:30-12:25 宇宙・天文光学 SA-2			9:30-12:25 宇宙・天文光学 SA-3	13:00-16:50		
	JAXA(相模原)の 研究者が語る宇宙コース			JAXA(つくば)の 研究者が語る宇宙コース			国立天文台の 研究者が語る天文コース	NICT(情報通信研究機構)の 研究者が語る開発動向		
アネックスホール F202	9:30-12:25 レーザー LE-1	13:10-16:05 レンズ設計・製造 LS-1		9:30-12:25 レーザー LE-2	13:10-16:05 レンズ設計・製造 LS-2		9:30-12:25 レーザー LE-3	13:10-16:05 レンズ設計・製造 LS-3		
	レーザーの基礎	光学超入門		光源技術	光学評価入門		応用トピック	照明光学入門と DOE入門		
アネックスホール F203	10:30-16:05 カーボンニュートラルと光・レーザー技術セミナー			10:00-16:15 光産業技術振興協会 報告会 2021年度 光技術動向セミナー			10:30-16:00 光産業技術振興協会 報告会 2021年度 光産業動向セミナー			
アネックスホール F204	10:00-12:55 赤外線 IR-1	13:40-16:35 紫外線 UV-1		10:00-12:55 赤外線 IR-2	13:40-16:35 紫外線 UV-2		10:00-12:55 産業用カメラ IC-1	13:40-16:35 産業用カメラ IC-2		
	赤外線技術の基礎	紫外線による ウイルス不活化への応用		赤外線応用技術	UV-C、UV-B光源とその応用		産業用カメラの最新動向 -TOF、単眼距離計測、環境認識	イメージセンサーの応用 -ロボットと車載を中心に		
展示会場内 特設会場1				13:00-16:00 天田財団 レーザプロセッシング 助成研究成果発表会			10:35-15:10 半導体産業×光・レーザー① 第1部 半導体リソグラフィの発展とレーザー			
							11:05-15:40 半導体産業×光・レーザー② 第2部 半導体後工程用レーザー加工装置およびレーザー			
展示会場内 特設会場2	11:30-12:15 JIALセミナー	13:30-14:15 JIALセミナー	14:30-15:15 出展社セミナー	15:30-16:15 JIALセミナー	12:30-13:15 JIALセミナー	13:30-14:15 JIALセミナー	15:00-17:00 Fraunhofer Photonic Research Cooperation Workshop	11:30-12:15 JIALセミナー	13:30-14:15 出展社セミナー	14:30-15:15 出展社セミナー
	レーザーライン	日本レーザー	オキサイド	セブンシックス	レーザー学会産業賞 授与式	コヒレント・ ジャパン	オフィール ジャパン	スペクトラ・ フィジックス	堀場製作所	サイバネット システム